NUBIC知的財産情報開示

開示日：2001年12月05日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

NUBIC管理番号：2001000102

表　　題	金属イオン吸着材				
技術分野	化学・薬品	有機材料	高分子材料		
適応製品	貴金属の回収装置、有害金属除去装置、特定金属イオンの分離装置、				
目　　的	各種環境媒体からの金属イオンの分離・回収・除去に有用な金属イオン吸着材の提供				
技術概要	本発明は、多孔質ポリエチレンフィルムにグラフト重合法を介してキレート交換基を導入したもので、金属イオン吸着能が飛躍的に向上した安価な金属イオン吸着材である。 本発明により、水質浄化、廃水処理などの有害金属の除去、希薄溶液からの貴金属の回収等の環境処理装置の開発が容易になった。				
整理番号	10279	担 当 者	斎藤　光史		

技術移転等をご希望の場合は，下記事項をご記入の上，本用紙にてお申込みください。
（FAX，e-mail，郵送いずれでも可。）
各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時			
氏　名（ふりがな）			
会社名			
所　属		役職	
電話番号		FAX番号	
E-mail			
連絡事項			

【申込み・問い合わせ先】
日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター（NUBIC）
〒102-8275　東京都千代田区九段南4－8－24 日本大学会館
TEL：03-5275-8139　FAX：03-5275-8328　e-mail：nubic@adm.nihon-u.ac.jp